

ALLEGATO 7 – OFFERTA TECNICA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI LITOGRAFIA LASER A SCRITTURA DIRETTA PER CLEANROOM, FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO IENTRANCE@ENL. CUP B33C22000710006 - CIG 99087975F5 - CUI F80054330586202300344

Il sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 in qualità di (*carica sociale*) _____
 della società _____
 sede legale _____
 sede operativa _____
 codice fiscale _____ Partita IVA _____
 n. telefono _____
 e-mail _____ PEC _____
 in qualità di¹ _____

con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica

OFFRE/OFFRONO

i seguenti elementi

(indicare per ciascuno criterio l'opzione SI o NO)

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	SI	NO	CRITERI MOTIVAZIONALI E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	RIFERIMENTO NELLE SCHEDE TECNICHE
1	PRESENZA DI UNA SECONDA SORGENTE LASER CON LUNGHEZZA D'ONDA (TRA LE SEGUENTI: 365, 375 E 385 nm) IN AGGIUNTA ALLA SORGENTE PRINCIPALE DI 405 nm CHE PERMETTA DI REALIZZARE LITOGRAFIE SU RESIST DI TIPO I-LINE			Presente: 8 punti Non presente: 0 punti	
2	PERMETTERE LA SCRITTURA DI UN PATTERN BINARIO			Presente: 10 punti Non presente: 0 punti	

¹ Inserire la dicitura opportuna, ad es., "Impresa singola" o "capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)", "mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)", ecc.

ALLEGATO 7 – OFFERTA TECNICA

	COSTITUITO DA LINEE DI LARGHEZZA DI 2 μm CON SPAZIATURA DI 5 μm SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI 100 mm X 100 mm CON UN RESIST POSITIVO DI SPESSORE MAGGIORE O UGUALE A 400 nm CHE RICHIEDA UNA DOSE MAGGIORE O UGUALE A 50 mJ/cm ² CON UNA VELOCITÀ UGUALE O SUPERIORE A 200 mm ² /MIN . LA VELOCITÀ DI SCRITTURA VERRÀ VERIFICATA IN FASE DI ACCETTAZIONE				
3	POSSIBILITÀ DI REALIZZARE STRUTTURE CON UNA RISOLUZIONE MIGLIORE RISPETTO A QUELLE RICHIESTE IN CAPITOLATO. IL SISTEMA DEVE ESSERE DOTATO DI UNA MODALITÀ DI LITOGRAFIA CHE PERMETTA DI REALIZZARE STRUTTURE CON DIMENSIONE CRITICA MINORE O UGUALE A 0.3 μm ($\leq 0.3 \mu\text{m}$)			Presente: 10 punti Non presente: 0 punti	
4	PRESENZA DI ULTERIORI ELEMENTI LITOGRAFICI O POSSIBILITÀ DI UPGRADE DEL SISTEMA CON ULTERIORI ELEMENTI LITOGRAFICI IN AGGIUNTA A QUELLI RICHIESTI COME REQUISITO MINIMO PER REALIZZARE STRUTTURE CON DIMENSIONE CRITICA MAGGIORE O UGUALE A 0.6 μm ($\geq 0.6 \mu\text{m}$). SI VALUTANO CASI IN CUI PER TALI RISOLUZIONI SIANO POSSIBILI UPGRADES O SIANO GIÀ INSTALLATE			Se presenti 2 o più modalità extra: 5 punti Se presente 1 modalità extra: 4 punti Se può/possono essere installate successivamente: 3 punti Se il sistema può essere dotato di solo due risoluzioni: 0 punti	
5	PRESENZA DI UN SISTEMA DI AUTOFOCUS PNEUMATICO IN AGGIUNTA ALL'AUTOFOCUS OTTICO GIÀ PRESENTE SUL SISTEMA. SI RICHIEDE CHE L'OPERATORE POSSA SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI AUTOFOCUS, ATTIVANDO SOLO QUELLO OTTICO NEL CASO DI SUBSTRATI SENSIBILI A VARIAZIONI DI PRESSIONE (QUALI MEMBRANE).			Presente: 5 punti Non presente: 0 punti	

ALLEGATO 7 – OFFERTA TECNICA

6	POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ED ESPORTARE IN FORMATO TIFF O PNG UNA MAPPA DI UNA REGIONE DEL SUBSTRATO MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI CON STITCHING ATTRAVERSO LE OTTICHE DEL SISTEMA			Presente: 4 punti Non presente: 0 punti	
7	FORNITURA DI UN SAMPLE HOLDER DI RISERVA CHE POSSA ESSERE SOSTITUITO IN AUTONOMIA DALL'OPERATORE DELLA MACCHINA. SI RICHIEDE LA FORMAZIONE PER LA RICALIBRAZIONE DEL SISTEMA DOPO LA SOSTITUZIONE DEL SAMPLE HOLDER, SE NECESSARIA.			Presente: 3 punti Non presente: 0 punti	
8	POSSIBILITÀ DI GESTIRE SUBSTRATI DI DIMENSIONI MASSIME SUPERIORE O UGUALE A 9" X 9" (POLLICI)			Presente: 2 punti Non presente: 0 punti	
9	POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LITOGRAFIE SU UN'AREA DI SCRITTURA DI 200 mm X 200 mm O SUPERIORE			Presente: 4 punti Non presente: 0 punti	
10	POSSIBILITÀ DI UPGRADE FUTURO DEL SISTEMA CON UN MODULO PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE FETTE CHE PERMETTA IL CARICAMENTO, ALLINEAMENTO, LITOGRAFIA E SCARICAMENTO DELLE FETTE IN MANIERA AUTOMATICA DA UNA O PIÙ STAZIONI CON PORTAFETTE (CASSETTE). NEL CASO DI ACQUISTO FUTURO DI TALE MODULO, SARÀ POSSIBILE RICONSIDERARE IL LAYOUT DELL'UNITÀ PRINCIPALE / MODULO ELETTRICO / MODULO DI CONTROLLO TEMPERATURA (SE PRESENTI).			Presente: 5 punti Non presente: 0 punti	
11	POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LITOGRAFIE DI TIPOLOGIA "GRAY SCALE" CON UN NUMERO DI LIVELLI DI 128 O SUPERIORE (≥ 128 LIVELLI).			Presente: 3 punti Non presente: 0 punti	
12	IL SISTEMA PERMETTE L'ALLINEAMENTO DEI MARKER "BACKSIDE" (ALLINEAMENTO FRONTE-RETRO) CON			Se $x \leq 1\mu\text{m}$: 8 punti Se $1\mu\text{m} < x \leq 2\mu\text{m}$: 4 punti	

ALLEGATO 7 – OFFERTA TECNICA

	ACCURATEZZA MIGLIORE DI 5 μm . SI VALUTANO DIVERSE PRECISIONI DI ALLINEAMENTO.			Se $2\mu\text{m} < x < 5\mu\text{m}$: 2 punti Se $x = 5\mu\text{m}$: 0 punti dove x = accuratezza di allineamento backside	
13	L'ALLINEAMENTO DEI MARKER "BACKSIDE" (ALLINEAMENTO FRONTE-RETRO) DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE UN MICROSCOPIO OTTICO POSIZIONATO SUL RETRO DEL SAMPLE HOLDER DOTATO DI APERTURE SULLA SUPERFICIE CHE GARANTISCONO UNA VISIONE DIRETTA DEI MARKER SENZA CHE SIANO PRESENTI ALTRI ELEMENTI / MATERIALI CHE POSSONO INTERFERIRE CON IL CAMMINO OTTICO DEL MICROSCOPIO E RIDURRE LA PRECISIONE. LE APERTURE SULLA SUPERFICIE DOVRANNO ESSERE ACCORDATE CON IL DESTINATARIO.			Presente: 4 punti Non presente: 0 punti	
14	PRESENZA DI UNA UNITA' DI CONTROLLO DI TEMPERATURA DI TIPOLOGIA ATTIVA. TALE UNITÀ DEVE GARANTIRE UNA TEMPERATURA STABILE IN FASE DI PROCESSO. SONO ESCLUSE TIPOLOGIE PASSIVE DI COMPENSAZIONE "DIGITALE" DELLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA.			Presente: 7 punti Non presente: 0 punti	
15	ESTENSIONE DI GARANZIA PER MULTIPLI DI 12 MESI IN AGGIUNTA AI 12 MESI PREVISTI DA CAPITOLATO TECNICO ALL'ART. 4.1.3			Se estensione per 24 mesi o maggiore: 2 punti Se estensione di 12 mesi: 1 punto Se assente: 0 punti	
16	POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LITOGRAFIE SU SUBSTRATI FLESSIBILI COME FILM DI POLI-IMMIDE (E.G. KAPTON) DI SPESSORE DI ALMENO 50 μm . SI VALUTANO DIVERSE MODALITÀ DI ANCORAGGIO DEI SUBSTRATI			Se il substrato è fissato con il sistema a effetto venturi: 5 punti Se il substrato è fissato con il sistema a vuoto con pompa a vuoto: 3 punti Se il substrato è fissato con clamp, frame sui bordi o vetro sull'intera area: 2 punti	

ALLEGATO 7 – OFFERTA TECNICA

				Se non è possibile ancorare questi substrati: 0 punti	
--	--	--	--	---	--

Luogo e data

Firma

*Firma digitale ex art. 24 e 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Per i soli operatori economici stranieri sprovvisti della firma digitale,
è ammessa la firma autografa, a condizione che venga allegata
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ex art. 65, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
e degli artt. 38, commi 1, 2 e 47 c. 1 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.*